

上海科技大学材料器件中心公共科研平台 2026 年研发工艺线测试加工服务收费标准

发布单位：上海科技大学材料器件中心

生效日期：2026 年 4 月 15 日

服务类型	设备名称	设备编号	设备级别	服务方式	设备机时费 (元/小时)	技术代工费 (元/小时)	最小计费单元	备注
光刻工艺服务	步进式光刻机	1-4	5 级	送样加工	4200	800	1 片	掩模板自备；机时费实行同一批次批量作业阶梯计费规则，该类作业为同一批次使用同一 job 完成多片重复曝光（1-5 片原价，6-25 片超出 7 折，26 片起超出 3 折）
	电子束曝光机全自动 EBL	1-13B	5 级	送样加工	3000	800	15min	
	自动涂胶显影机	1-2	5 级	送样加工	600	500	30min	不额外收取耗材费
	3D 电子扫描显微镜半自动 EBL	1-14B	4 级	自主操作或送样加工	2000	800	30min	
	接触式光刻系统	1-1	4 级	自主操作或送样加工	1000	500	30min	
	高速高分辨率无掩模板光刻仪 MLA	1-3	4 级	自主操作或送样加工	1000	500	30min	

投影数字光刻系统 (MiScan)	1-18	4级	自主操作或 送样加工	500	500	30min	
低温恒温水槽	1- 15B	2级	自主操作或 送样加工	400	500 (按次 收费)	30min	
匀胶通风橱(大仪名称: 普通化学 清洗槽)	1- 17B	2级	自主操作或 送样加工	400	500	30min	不额外收取耗材费
匀胶通风橱(大仪名称: 有机清洗 通风橱)	1-5	2级	自主操作或 送样加工	400	500	30min	不额外收取耗材费
匀胶通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀 台)	1-6	2级	自主操作或 送样加工	400	500	30min	不额外收取耗材费
显影通风橱	1-7	1级	自主操作或 送样加工	300	500	30min	不额外收取耗材费
显影通风橱(大仪名称: 普通化学 清洗槽)	1-8	1级	自主操作或 送样加工	300	500	30min	不额外收取耗材费
显影通风橱(大仪名称: 普通化学 清洗槽)	1- 16B	1级	自主操作或 送样加工	300	500	30min	不额外收取耗材费
HMDS 烘箱	1-9	2级	自主操作或 送样加工	200	500	30min	
真空烘箱	1-11	1级	自主操作或 送样加工	200	500	30min	
净化烘箱	1-12	1级	自主操作或 送样加工	100	500	30min	

	高温烘箱	1-10	1级	自主操作或 送样加工	100	500	30min	
镀膜工艺服 务	氮化铝集成溅射仪	3-8	5级	送样加工	3000	800	30min	MSQ 腔体非常规靶材自备
	低压化学气相沉积系统 LPCVD	3- 24B	5级	送样加工	1000	800 (按次 收费)	60min	单炉管收费标准, 各炉管单独 计费
	磁控溅射沉积系统 Mo-Cu 镀膜 机	3-9	5级	送样加工	1000	500	30min	
	电子束沉积系统 非磁性金属镀膜 (PVD200)	3-10	5级	送样加工	1000	500	30min	
	化学气相沉积系统(PECVD)	3-11	3级	自主操作或 送样加工	1000	500	30min	
	化学气相沉积系统(ICPCVD)	3-12	5级	送样加工	1000	500	30min	
	原子层积系统 ALD	3-16	3级	自主操作或 送样加工	1200	500	30min	
	多靶材溅射仪 SPUTTER 介质镀 膜 PVD3	3-5	5级	送样加工	1000	500	30min	
	多靶材溅射仪 SPUTTER 磁性金 属镀膜 PVD2	3-6	3级	自主操作或 送样加工	1000	500	30min	
	多靶材溅射仪 SPUTTER 非磁性 金属镀膜 PVD1	3-7	3级	自主操作或 送样加工	1000	500	30min	
热蒸发 (国产 Al、In)	3-3	3级	自主操作或 送样加工	500	500	30min		

	多源炉电子束蒸发系统 金属镀膜	3-4	3级	自主操作或 送样加工	1000	500	30min	
	有机高分子镀膜机	3- 25B	3级	自主操作或 送样加工	500	500	30min	
	晶圆电镀系统	3- 26B	3级	自主操作或 送样加工	500	500	30min	
	高深宽比金属柱制备系统	3-27	3级	自主操作或 送样加工	1000	500	30min	
	电子束金属蒸发系统	3-28	4级	自主操作或 送样加工	1000	500	30min	
刻蚀工艺服 务	深硅刻蚀机	3-21	5级	送样加工	1500	800	30min	载片自备, 制样费一事一议
	双离子源刻蚀系统 IBE	3-2	3级	自主操作或 送样加工	1500	800	30min	SIMS 分析机时费上浮 100%
	HBR 刻蚀机 硅刻蚀	3-15	5级	送样加工	1500	500	30min	使用液氮期间, 设备机时费上 浮 100%
	等离子刻蚀系统 三五族刻蚀机	3-14	3级	自主操作或 送样加工	1500	500	30min	使用终点监测功能, 设备机时 费上浮 100%
	高功率等离子体刻蚀机 不含钨的 三五族刻蚀机	3-18	3级	自主操作或 送样加工	1500	500	30min	
	反应离子刻蚀系统	3-13	3级	自主操作或 送样加工	1000	500	30min	

	ICP 介质刻蚀机 硅基材料刻蚀机	3-17	5 级	送样加工	1500	500	30min	使用终点监测功能, 设备机时费上浮 100%
	反应离子刻蚀机 (鲁汶 ICP)	3-20	3 级	自主操作或送样加工	1500	500	30min	
	氟化氙刻蚀仪 XEF2 ETCHER	3-19	3 级	自主操作或送样加工	1200	500	30min	不额外收取耗材费
	HF 干法刻蚀机	3-22	3 级	自主操作或送样加工	1200	500	30min	不额外收取耗材费
	等离子去胶机 Asher	3-23	3 级	自主操作或送样加工	500	500	30min	
湿法工艺服务	晶圆清洗刻蚀通风橱	2-09B	2 级	自主操作或送样加工	400	500	30min	耗材需求量大时, 联系中心工作人员据实收取
	RCA 晶圆清洗通风橱	2-10B	2 级	自主操作或送样加工	400	500	30min	
	氮化物清洗槽 磷酸	2-3	2 级	自主操作或送样加工	400	500	30min	
	6 寸有机清洗通风橱(大仪名称: 1.5M 酸碱通风柜)	2-1	2 级	自主操作或送样加工	400	500	15min	不额外收取耗材费
	小样品有机清洗通风橱(大仪名称: 普通化学通风柜 4)	2-2	1 级	自主操作或送样加工	300	500	15min	不额外收取耗材费
	HF 及 BOE 专用通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀台通风橱 3)	2-4	1 级	自主操作或送样加工	300	500	15min	不额外收取耗材费

	普通酸刻蚀及清洗通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀台通风橱 2)	2-5	1 级	自主操作或送样加工	300	500	15min	不额外收取耗材费
	金属刻蚀及超声清洗通风橱(大仪名称: 湿法腐蚀台)	2-6	1 级	自主操作或送样加工	300	500	15min	不额外收取耗材费
	甩干机 四六寸晶圆	2-7	1 级	自主操作或送样加工	300	500	15min	
	甩干机 四八寸晶圆	2-8	1 级	自主操作或送样加工	300	500	15min	
	晶圆甩干机 四六寸晶圆	2-11B	1 级	自主操作或送样加工	300	500	15min	
后道工艺服务	倒焊机	5-6	4 级	自主操作或送样加工	1500	500	30min	
	划片机 Dicing saw	5-4B	5 级	送样加工	500	800	30min	提供适合切 Si、玻璃、GaAs 的刀片, 其余特种刀片需自备
	减薄抛光系统 lapping	5-3B	4 级	自主操作或送样加工	500	500	30min	样品自备
	减薄抛光系统 抛光机 CMP	5-5B	2 级	自主操作或送样加工	500	500	30min	抛光布、抛光液自备
	贴片机	5-2	3 级	自主操作或送样加工	500	500	30min	模具自备
	打线机 (7476D)	5-1	2 级	自主操作或送样加工	500	500	30min	

量测技术服务	聚焦离子束显微镜	4-16B	4级	自主操作或送样加工	2000	800	30min	SIMS 质谱、TEM 样品制备、三维重构与冷台等附件按使用机时收取
	原子力显微镜 AFM	4-3	3级	自主操作或送样加工	800	500	30min	探针自备；代工时，若使用中心的探针，需另收取探针耗材费
	3D 电子扫描显微镜 SEM	4-1	3级	自主操作或送样加工	1000	500	30min	做 EDX 能谱期间，设备机时费上浮 100%
	3D 电子扫描显微镜 SEM	4-15	3级	自主操作或送样加工	1000	500	30min	做 EDX 能谱期间，设备机时费上浮 100%
	高分辨 X 射线衍射仪	4-17B	3级	自主操作或送样加工	1000	500	30min	
	低温光电测试系统	4-18	3级	自主操作或送样加工	400	500	30min	打线制样按打线机机时收取，使用平台样品载体收费耗材费
	高真空离子溅射仪 SEM 制样磁控溅射	4-14	2级	自主操作或送样加工	500	500	15min	不额外收取耗材费
	椭偏仪 (IR-VASE Mark II M-2000UI)	4-10	2级	自主操作或送样加工	500	500	15min	
	椭偏仪 IR	4-4	2级	自主操作或送样加工	500	500	30min	
	白光轮廓仪 3D Laser	4-9	2级	自主操作或送样加工	500	500	15min	

	光谱反射膜厚仪 Filmmetrics(F50-UV)	4-7	2级	自主操作或 送样加工	100	500	15min	
	表面轮廓仪 KLA 台阶仪	4-5B	2级	自主操作或 送样加工	200	500	15min	
	线性扫描轮廓仪	4-6	2级	自主操作或 送样加工	500	500	15min	
	光学显微镜(大仪名称: 显微镜)	4-12	2级	自主操作或 送样加工	1	500	30min	
	显微镜 (DM4M M205C)	4-8	2级	自主操作或 送样加工	1	500	30min	
	显微镜 (M2700M)	4-13	2级	自主操作或 送样加工	1	500	30min	
	应力测量仪	4-11	2级	自主操作或 送样加工	200	500	15min	
	手动探针测试系统	4- 19B	3级	自主操作或 送样加工	500	500	30min	
其他工艺服 务	快速退火炉 RTA	6-1	3级	自主操作或 送样加工	500	500	30min	
	临界点干燥仪	6-2	2级	自主操作或 送样加工	500	500	30min	
其他类型服 务	综合培训费	综合培训费 2100 元/人次 (含六台一级设备培训费 600 元/人次)						
	净化空间使用费	按 50 元/小时收取						

	个人物品存储及清理费	存储个人工具费：每天收取 3 元/天（白光区，约 30cm*30cm*50cm）
		存储个人样品费：每天收取 5 元/天（白光区电子干燥柜，约 60cm*20cm*60cm）
		化学试剂免收存放费，平台仅提供存放空间 (需严格按平台化学试剂进出入等规则)
	特殊工艺技术服务费	含工艺集成设计等服务，两步功能模块及以上集成工艺，按总代工费的 20%收取集成工艺设计费； 其他情况另协商报价；
	加急服务	咨询联系人：闫老师，yanxm@shanghaitech.edu.cn
*以上价格为含税价格。		